

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

【公表番号】特表2006-504229(P2006-504229A)

【公表日】平成18年2月2日(2006.2.2)

【年通号数】公開・登録公報2006-005

【出願番号】特願2003-582849(P2003-582849)

【国際特許分類】

H 01 M 8/02 (2006.01)

H 01 M 8/10 (2006.01)

H 01 M 8/12 (2006.01)

【F I】

H 01 M 8/02 E

H 01 M 8/10

H 01 M 8/12

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月10日(2006.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

取付具アセンブリから膜電極アセンブリ(MEA)を、該取付具アセンブリ内でのMEA接合の後に分離する方法であって、該取付具アセンブリが、該MEAの第1表面に接触する第1取付具と該MEAの第2表面に接触する第2取付具とを備え、該第1および第2取付具がそれぞれ実質的多孔性領域を備えてなる、方法において、

前記取付具アセンブリの前記第1取付具を安定化するステップと、

前記取付具アセンブリの前記第2取付具を安定化するステップと、

前記第2取付具が安定化される間に、前記第1取付具を加圧して、前記MEAの前記第1表面を前記第1取付具から分離させるステップと、

前記第1取付具が安定化される間に、前記第2取付具を加圧して、前記MEAの前記第2表面を前記第2取付具から分離させるステップと、

前記第1取付具の近傍から前記第2取付具を移動させて、前記第1取付具からの前記MEAの取出しを可能にするステップと、
を具備することを特徴とする方法。

【請求項2】

前記第1取付具と前記MEAの前記第1表面とに圧力が加えられている間に、前記第2取付具と前記MEAの前記第2表面とに真空を与え、続いて、前記第2取付具と前記MEAの前記第2表面とに圧力が加えられている間に、前記第1取付具と前記MEAの前記第1表面とに真空を与え、

前記第1取付具を安定化するステップは、前記第1取付具をつかんで該第1取付具を安定させることを含み、

前記第2取付具を安定化するステップは、真空を用いて前記第2取付具を安定させることを含む、

請求項1に記載の方法。

【請求項3】

取付具アセンブリから膜電極アセンブリ（MEA）を、該取付具アセンブリ内でのMEA接合の後に分離する装置であって、該取付具アセンブリが、該MEAの第1表面に接触する第1取付具と該MEAの第2表面に接触する第2取付具とを備え、該第1および第2取付具がそれぞれ実質的多孔性領域を備えてなる、装置において、

第1ポートを有するベースであって、該第1ポートが前記第1取付具の前記多孔性領域を介して前記MEAの前記第1表面と流体連通するように、前記取付具アセンブリを受容するベースと、

支持体上に移動可能に取付けられるグリッパアセンブリであって、グリッパ機構と第2ポートとを有し、該第2ポートが、前記第2取付具の前記多孔性領域を介して前記MEAの前記第2表面と流体連通するグリッパアセンブリと、を具備し、

前記第1および第2ポートが、選択的に加圧かつ排気されて、それぞれ前記第1および第2取付具から前記MEAの前記第1および第2表面を分離し、

前記グリッパアセンブリが、前記第2取付具の一対の両縁を解放可能につかんで、前記第1取付具の近傍から前記第2取付具を移動させるようになっていること、を特徴とする装置。